⑩ 日本国特許庁(IP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-118621

50Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

49公開 平成2年(1990)5月2日

1/37 3/10 G 02 F HOIS

3/109

7348-2H 7630-5F 7630-5F \mathbf{Z}

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

高調波発生装置

21)特 願 昭63-272031

29出 願 昭63(1988)10月28日

72)発 明 者 徬 藤 訓 題 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝生産

技術研究所内

(2)発 明 者 今 井 信

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝生産

技術研究所内

勿出 願 人 株式会补東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

74代 理 Τ 弁理十 鈴汀 武彦 外2名

明

1. 発明の名称

高調波発生裝置

2. 特許請求の範囲

パルスレーザ光をそれぞれ異なる偏光成分に 分ける偏光ビームスプリッタと、この偏光ビーム スプリッタで分けられた各偏光成分のうちいずれ か一方の偏光成分を遅延する遅延光学系と、この 遅延光学系で遅延された偏光成分と前記偏光ビー ムスプリッタで分けられた各偏光成分のうち他方 の偏光成分とを合成してこれら偏光成分の重なっ た期間をパルス幅とする高調波のパルスレーザ光 に変換する高調波変換系とを具備したことを特徴 とする高調波発生装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、2次高調波等のレーザ光を発生す る高調波発生装置に関する。

(従来の技術)

例えば、 2 次高調波のレーザ光は、基本波の レーザ光をSHG(セカンド・ハーモニック・ジ ェネレーション)に供給することによって発生し ている。そして、この2次高調波のレーザ光のパ ルス幅は、Qスイッチを備え、このQスイッチの 繰返し周波数を変えることにより変化させている。

ところが、Qスイッチを用いて2次高調波のパ ルス幅を変化させる方法では、パルス幅を数10ns ~200ns の範囲で変化させることは出来るが、こ の範囲よりも短い数ns以下でパルス幅を変化させ ることは不可能となっている。しかるに、パルス 幅の短い2次高調波は例えば化学反応に適用する に好適であって、かかるレーザ光を得ることが要 望されている。

(発明が解決しようとする課題)

以上のように2次高調波を長いパルス幅で得 ることはできるが、パルス幅を数ns以下に短くす ることは不可能であった。

そこで本発明は、高調波のパルスレーザ光のパ

1

2

ルス 幅を 短いバルス 幅から 長いバルス 幅まで所望のパルス 幅に変化することができる 高調波 発生装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

(作用)

このような手段を備えたことにより、パルスレーザ光が偏光ビームスプリッタによりそれぞれ異なる偏光成分に分けられていずれか一方の偏光成分が遅延光学系に送られるとともに他方の偏光

- 3 -

の偏光成分つまり直線偏光成分の出力方向には 遅延光学系3が配置されている。この遅延光学系 3 は 偏 光 成 分 s の パ ル ス レ ー ザ 光 を 所 定 期 間 Δ t だけ遅延する機能を有するものである。具体的な 構成は、ミラー4により偏光成分sのパルスレー ザ光を反射して可変遅延系5に導き、さらにこの 可変遅延系5で所望期間だけ遅延されたパルスレ ーザ光をミラー6で反射してピームスプリッタ2 に導くようになっている。このピームスプリッタ 2 は、偏光ビームスプリッタ1からの偏光成分p のパルスレーザ光と遅延光学系3からの偏光成 分sのパルスレーザ光とを合成するものであり、 この合成されたパルスレーザ光の出力方向には SHG(セカンド・ハーモニック・ジェネレーシ ョン) 結晶(以下, SHGと省略する) 7が配置 されている。このSHG7は非線型結晶をいわゆ るタイプⅡ型の位相整合が取れるようにカットし たものである。ところで、このSHG7は第2図 に示すように結晶の光学軸o,eがそれぞれ各偏 光成分p,sと平行となるように配置されており、 成分が高調波変換系に送られる。しかるに、高調波変換系には遅延光学系で遅延された偏光成分と偏光ビームスブリッタからの遅延されない偏光成分とが入射し、この高調波変換系はこれら偏光成分の重なった期間をパルス幅とする高調波のパルスレーザ光に変換する。

(実施例)

以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。

第1図は高調被発生装置の構成図である。同図において1は偏光ビームスプリッタであって、この偏光ピームスプリッタ1には波長 2のパルスレーザ光 Q が入射している。 なお、このパルスレーザ光 Q は互いに直交する各直線 偏光成分 p , s を有している。 従って、 偏光ビームスプリッタ1はれかける作用を行なう。 この 偏光 ビームスプリック 1 で分けられた各偏光成分 p , s のうち一方の偏光成分、 例えば直線 偏光成分 p の出力方向にはビームスプリック 2 が配置されるとともに他方

- 4 -

これら光学軸o、eにそれぞれ各偏光成分p、sが入射した場合にこれら偏光成分p、sが重なり合った期間をパルス幅とする2次高調波のパルスレーザ光Q~に変換する作用を有するものである。なお、上記ピームスプリッタ2及びSHG7により高調波変換系が構成されている。又、SHG7の2次高調波パルスレーザ光の出力光路上にはプリズム8が配置されている。

次に上記の如く構成された装置の作用について説明する。

パルスレーザ光Qが偏光ビームスブリッタ1に入りまると、この偏光ビームスプリッタ1はパルスレーザ光Qを各直線偏光成分p,sのうちを直線偏光成分p,sのうちを直線偏光成分p,sのうちを直線に光成分pはビームスプリッタ2に送られる。ここで光に変更と光学系3に設定された足延期間に近に送いる。ないにより、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、偏光により、ビームスプリッタ2は、

- 6 -

スプリッタ1からの偏光成分pのパルスレーザ光と遅延光学系3で遅延された偏光成分sのパレスレーザ光とを合成してSHG7に送る。このとき、SHG7には光学軸oに対して直線偏光成分pが平行に入射する。光学軸eに対して直線偏光成分pが明る。で、SHG7はなりsが平行に入射する。で、SHG7はなりった期間 Δ t ovに 2 次高調波(λ/2)のパルスを Δ t sh、パルスレーザ光 Q のパルス幅を Δ t sh、パルスレーザ光 Q のパルス幅を Δ t f、遅延光学系3での遅延期間を Δ t とすると、

Δ t sh < Δ t ov = (2 Δ t - Δ t f) / 2
の 関係が成り立つ。 しかるに、この関係から遅延期間 Δ t を可変することにより 2 次高調波のパルス幅 Δ t shを変えることができる。従って、 2 次高調波のパルスレーザ光 Q ´ のパルス幅は各偏光成分 p, s との重なり期間に応じて短くなる。

このように上記一実施例においては、バルスレーザ光Qを偏光ビームスブリック1により各偏光

- 7 -

[発明の効果]

以上詳記したように本発明によれば、高調波のパルスレーザ光のパルス幅を短いパルス幅から 長いパルス幅まで所望のパルス幅に変化すること ができる高調波発生装置を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係わる高額波発生装置の一 実施例を示す構成図、第2図は同装置における SHGの作用を示す図、第3図は同装置の2次高 調波発生作用を説明するための図である。

1 … 偏光 ピームスプリッタ、 2 … ピームスプリッタ、 3 … 遅延光学系、 4 , 6 … ミラー、 5 … 可変遅延系、 7 … S H G 。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

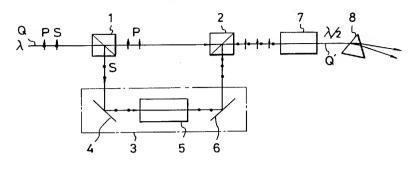
成分 p . s に分けてこのうち 個 光成分 s を遅延光学系 3 に送って遅延し、さらにこの遅延された 偏光成分 s と 偏光成分 p を合成して重り合った 期間をパルス 幅とする 2 次高 調液のパルスレーザ光Q ~ に変換する構成としたので、パルス 幅を数 ns から数 100ns までの短パルスから 長パルスをでることができる。例えば、基本波のパルスレーザ光Q としてパルス 幅 180ns の Y A G レーザ (波長1.08 μm)を使用するとともに S H G 7 として K T P を用い、かつ遅延光学系 3 で 25nsの遅延を行なったところ上記式

Δ t sh < 118ns

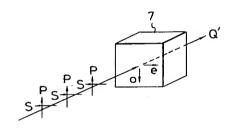
を満足するパルス幅 90nsの 2 次高 額波 (波長 0.58 μm) が得られる。

なお、本発明は上記一実施例に限定されるものでなくその主旨を逸脱しない範囲で変形してもよい。例えば、上記一実施例では2次高調波の発生について説明したが、3次以上の高調波の発生にも適用できる。

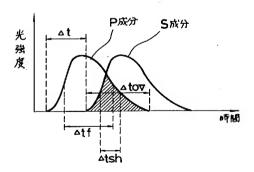
- 8 -



第 1 図



第 2 図



第 3 図

PAT-NO: JP402118621A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02118621 A

TITLE: HIGHER HARMONICS GENERATOR

PUBN-DATE: May 2, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

GOTOU, KUNIAKI IMAI, SHINICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP63272031

APPL-DATE: October 28, 1988

INT-CL (IPC): G02F001/37, H01S003/10, H01S003/109

US-CL-CURRENT: 359/328

ABSTRACT:

PURPOSE: To change the pulse width of the pulse laser beam of higher harmonics from a short pulse width up to a long pulse width by providing a polarized beam splitter, a delay optical system and a higher harmonics converting system to execute a conversion to the pulse laser beam of the higher harmonics.

CONSTITUTION: A beam splitter 2 synthesizes the pulse laser beam of polarized components (p) from a polarized beam splitter 1 and the pulse laser beam of polarized components (s) delayed by a period Δt by a delay optical system 3 and sends it to an SHG (second heamonic generation) 7.

At such a time, onto the SHG 7, the linearly polarized components (p) are made incident in parallel on an optical axis (o), and simultaneously, the linearly polarized components (s) are made incident in parallel on an optical axis (e). Consequently, the SHG 7 executes an output in conversion to a pulse laser light Q' of a quadratic higher harmonics (λ /2) in a period Δ t ov in which respective linearly polarized components (p) and (s) are overlapped. Namely, by varying the delay period Δ t, a pulse width Δ t sh of the quadratic higher harmonics can be changed.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio